

自然科学研究機構国立天文台 特定契約職員(先端技術センター 特定技術職員) 公募

1. 募集職種・人員 特定契約職員(特定技術職員) 1名
2. 所属部署 先端技術センター
3. 就業場所 東京都三鷹市大沢2-21-1
(変更の範囲) 変更なし
4. 業務内容
 - 超伝導デバイスの開発および開発のための装置の条件出し
 - クリーンルーム、プロセス装置、超伝導デバイスの評価装置等の維持管理
 - 走査型電子顕微鏡(SEM)、原子間力顕微鏡(AFM)、光学顕微鏡等を用いた試料の観察や分析
 - 低温測定装置を用いた電気特性の測定と評価
(変更の範囲) 変更なし
5. 雇用期間
2024年9月1日以降なるべく早く ~ 2025年3月31日 (試用期間なし)
更新可能性: 有、最長 2026年3月31日 まで ※
※但し、着任前6か月以内に自然科学研究機構の有期雇用職員であった場合は、雇用期間は通算有期雇用期間が5年を超えないように設定されます。
6. 勤務形態
週5日(月~金勤務。土・日・祝日、年末年始(12/29-翌年1/3)は休日)
始業時刻 8:30~終業時刻 17:15(休憩60分、週あたり38.75時間勤務)
7. 待遇等
日給 8,991円~ 10,944円(経験等により決定。給与は毎月月末締、翌月払い)
(参考例: 大学卒業後4年程度の社会人経験がある方の場合...10,600円程度)
賞与年2回、通勤手当支給(上限55,000円/月)、住居手当支給(上限28,000円/月)
文部科学省共済組合短期給付(健康保険)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入
有給休暇(年次休暇、リフレッシュ休暇、忌引等)あり
託児施設あり(生後57日~) ※状況によっては利用できない場合もあります
敷地内禁煙(屋外に指定喫煙場所あり)
※その他詳細は自然科学研究機構の規程による。
8. 応募資格
 - クリーンルームでの半導体あるいは超伝導デバイスの製造に関連する作業経験があること。
 - ドライエッチングやスパッタ成膜などの真空装置を使用するプロセスのうち、少なくとも1種類以上のプロセスに精通していること。
 - スパッタ装置や真空装置の保守作業の経験を有すること。
 - PCを用いてプロセス工程の管理等の業務処理を行う能力があること。
9. 選考方法
書類選考及び面接(対面又はオンライン)による選考
10. 提出書類
履歴書(写真貼付)、職務経歴書、動機・抱負をまとめた文書(A4で1枚程度)
11. 応募締切 2024年7月19日(金)日本時間正午必着
12. 提出方法
(メール) E-mail : apply-job_AT_ao.ac.jp
上記提出書類をPDFに変換し、送付してください。
応募時の注意点:
 - ・ 上記メールアドレスの“_AT_”を@に置き換えて送信してください。(以下、同様)
 - ・ メールタイトルに「国立天文台先端技術センター(特定技術職員)応募」と明記ください。
 - ・ 一度に添付するファイルのサイズは10MB以内としてください。
 - ・ 応募書類受理の後、祝休日を除き3日以内に受領確認のメールを送ります。メールが届かない場合には、下記問い合わせ先までご連絡ください。

13. 問合せ先

(応募に関する内容)

国立天文台 事務部総務課人事係

TEL : 0422-34-4014

E-mail : apply-job_AT_nao.ac.jp

(職務内容に関する内容)

国立天文台先端技術センター 牧瀬圭正

E-mail : kazumasa.makise_AT_nao.ac.jp

14. 注意事項

- ・ 応募に際していただいた情報は、この選考および事務連絡以外のいかなる目的にも使用いたしません。選考後、採用に至った方以外の応募書類は責任を持って破棄します。
- ・ 面接に要する費用（交通費等）は応募者の自己負担となります。

15. 募集者名称

大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台

16. 備 考

- ・ 自然科学研究機構は男女共同参画推進に取り組んでいます。
国立天文台における男女共同参画社会の実現を目指した取り組みについては、下記リンクをご覧ください。

<https://www2.nao.ac.jp/~open-info/gender-equality/>